# パラレル機構を用いた走査型 プローブ顕微鏡用微動ステージ

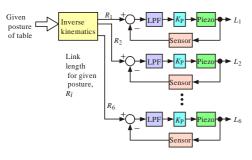
ナノメータオーダの加工を目的とした加工機の 重要な要素の一つに微動テーブルがある. 市販 の走査型プローブ顕微鏡は、チューブ型圧電素 子を用いているため、自由度が低い。本研究では、 スチュワート型パラレル機構を用いて6自由度微 動ステージを試作し、誘導電荷フィードバック法に より変位を制御した.

可動範囲は100×100×20μm, 固有振動数はz軸 方向で75Hzであった. 走査速度が高く取れるよう にxv方向の剛性を高め、高いz軸方向の分解能が 得られるように、xy平面とリンクのなす角度を6°に した.

各リンク長を制御することでテーブル変位を制 御するセミクローズドループ方式とした. テーブル の目標位置および姿勢は、逆運動学を解くことで 各軸の長さに分解される.

誘導電荷フィードバックによりテーブルの運動を 制御した結果、変位フィードバックと同等の運動 精度が得られた.

試作したステージを用いて原子間力顕微鏡を構 成し、フォースカーブを測定した.これを用いて運 動精度を測定した結果、z軸方向で16nm(σ)の繰 返し精度を持つことが明らかになった.また, 20 x 20μmの範囲で直線性のよい回折格子像が 観察された. しゅう動部がないため、真空中でも使 用可能である。

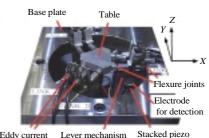


JRL: http://www.toyota-ti.ac.jp/Lab/Kikai/5k60,

Block diagram of control system

### Cross-talk ratio

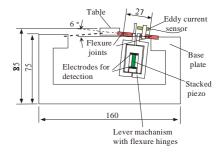
Feedback	Cross talk ratio		Pitching error
	x/y	z/y	μrad
None	19.6	8.2	12
Displacement	11.7	3.9	17
Induced charge	3.5	4.7	17



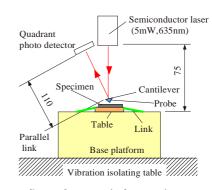
Eddy current displacement

Lever mechanism with flexure hinges

#### Appearance of device



#### Sectional view



Setup for atomic force microscope

## Size: 160×160×85 mm Mass of table: 24 g

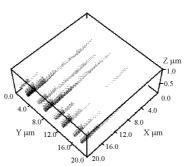
Movable range:

**Specifications** 

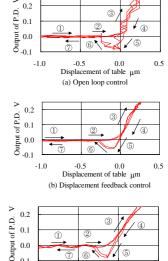
 $100 \, \mu \text{m in } xy$ ,  $20 \, \mu \text{m in } z$ Resonance frequency:

100 Hz in xy, 75 Hz in z Degrees of freedom: 6 Actuators: Piezoelectric actuators

Magnification: 12.5



**AFM** image of diffraction gratings



0.0 -0.1

Force curve on Silicon

Displace (c) Induced charge feedback control

nent of table

0.5